課題番号 :F-17-NU-0022

利用形態 :機器利用

利用課題名(日本語) : 微細加工表面での動的接触角決定機構の解明

Program Title (English) : Dynamic Contact Angle on a Micro-Structured Solid Surface

利用者名(日本語) :松田悠平, <u>伊藤高啓</u> Username (English) :Y. Matsuda, <u>T. Ito</u>

所属名(日本語) :名古屋大学大学院工学研究科

Affiliation (English) : Graduate School of Engineering, Nagoya University キーワード/Keyword : リソグラフィ・露光・描画装置, 接触角, 三相界線, 接触線

# 1. 概要(Summary)

液体一気体間界面が固体表面と接する線(接触線)の 運動やそこでの界面と固体面のなす角度(接触角)は液 体の固体面の濡れを支配するだけでなく、液体界面の運 動の境界条件となって界面運動に大きな影響を与えるた め、それらの挙動を明らかにすることはコーティングや液 滴冷却などの工学分野においてきわめて重要である。本 研究では特に固体表面の微細な凹凸や濡れ性の局所変 化による濡れ縁(接触線)および動的接触角(接触線が運 動する際の界面一固体表面の成す角)の挙動を明らかに することを目的として行った。本プラットフォームでは上記 の目的のため、微細な凹凸や濡れ性の局所の差異を固 体表面に設けるための加工作業を行った。

### 2。実験(Experimental)

【利用した主な装置】レーザー描画装置(DWL66FS)、RIE エッチング装置(RIE-10NR)、デジタルマイクロスコープ一式(VK-9700)

#### 【実験方法】

レーザー描画装置にてブランクマスクを作成し、フォトリソグラフィにて試料材料である熱酸化膜付 Si ウェハーに転写の後、100~1000µm の間隔で配置された深さ 100nmオーダーの溝を RIE にて作成した。加工領域の大きさは10mmx25mm とした。エッチングは RIE のレシピに従い、100nm の溝深さを目標として2分、500nm の溝深さを目標として10 分実施したものを作成した。

### 3。結果と考察 (Results and Discussion)

測定実験は加工試料を水槽内に鉛直に固定し、ポンプで試料液体(エチレングリコール)を水槽に一定速度で注入することにより、固体表面上を接触線が運動する装置を用いて行った。測定の結果、エッチングされた部分と

そうでない部分では接触角が異なることがわかった。Fig。 1 には 100nm の深さの溝を持つ試料を用いたときの、水 平界面位置からの接触線の相対高さの時間変化の例を 示す。接触線が凹凸に固着して一時的に固体面の特定 の位置に留まるために接触線相対高さが減少する期間 (1~1.5s など)があることがわかる。

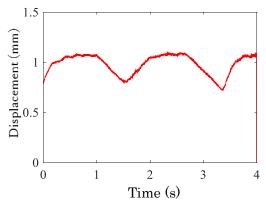


Fig.1 Trend of measured contact line height relative to the static interface.

### 4. その他・特記事項(Others)

なし.

## 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

- (1) 松田 悠平, 伊藤 高啓, 辻 義之ら, 混相流シンポジウム 2017, 平成 29 年 8 月 20 日.
- (2) 松田 悠平, 伊藤 高啓, 辻 義之ら, 日本流体力学会中部支部講演会 2017, 平成 29 年 12 月 1 日.

### 6. 関連特許(Patent)

なし.